

共用設備一覧

加工・作製 Processing /Manufacturing

微細加工 Microfabrication

装置名	メーカー名	型番
電子ビーム描画装置 [JBX-8100FS]	日本電子(株)	JBX-8100FS
電子ビーム描画装置 [ELS-F125]	(株)エリオニクス	ELS-F125
電子ビーム描画装置 [ELS-BODEN100]	(株)エリオニクス	ELS-BODEN
レーザー描画装置 [DWL66+]	ハイデルベルグ・インストルメンツ(株)	DWL66+
マスクレス露光装置 [DL-1000]	(株)ナノシステムソリューションズ	DL-1000
マスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P]	(株)ナノシステムソリューションズ	DL-1000 / NC2P
マスクレス露光装置 [MLA150]	ハイデルベルグ・インストルメンツ(株)	MLA150
マスクアライナー [MA-6]	ズース・マイクロテック	MA-6
水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #1]	サムコ(株)	AQ-500
水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #2]	サムコ(株)	AQ-500
UVオゾンクリーナー [UV-1]	サムコ(株)	UV-1
スパッタ装置 [JSP-8000]	(株)アルバック	J sputter
スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2]	芝浦メカトロニクス(株)	CFS-4EP-LL
スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #3]	芝浦メカトロニクス(株)	CFS-4EP-LL
電子銃型蒸着装置 [RDEB-1206K]	(株)アールデック	RDEB-1206K
電子銃型蒸着装置 [ADS-E86]	(株)アールデック	ADS-E86
電子銃型蒸着装置 [MB-501010]	(株)エイコーエンジニアリング	MB-501010
電子銃型蒸着装置 [UEP-3000BS]	(株)アルバック	UEP-3000BS
原子層堆積装置 [SUNALE R-150]	アルテック(株)/Picosun	SUNALE R-150 ALD
原子層堆積装置 [AD-230LP]	サムコ(株)	AD-230LP
SiO₂プラズマCVD装置 [PD-220NL]	サムコ(株)	PD-220NL
SiNプラズマCVD装置 [PD-220NL]	サムコ(株)	PD-220NL
リフトオフ装置 [KLO-150CBU]	(株)カナメックス	KLO-150CBU
CCP-RIE装置 [RIE-200NL]	サムコ(株)	RIE-200NL
ICP-RIE装置 [RIE-101iPH]	サムコ(株)	RIE-101iPH
ICP-RIE装置 [RV-APS-SE]	住友精密工業(株)	MUC-21 RV-APS-SE
ICP-RIE装置 [CE300I]	(株)アルバック	CE300I
シリコンDRIE装置 [ASE-SRE]	住友精密工業(株)	MUC-21 ASE-SRE
原子層エッチング装置 [PlasmaPro 100 ALE]	オックスフォード・インストルメンツ(株)	PlasmaPro 100 Cobra 300 ALE
赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #1]	アドバンス理工(株)	RTP-6

装置名	メーカー名	型番
赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #2]	アドバンス理工(株)	RTP-6
赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #3]	アドバンス理工(株)	RTP-6
ダイシングソー [DAD322]	(株)ディスコ	DAD322
ダイシングソー [DAD3220]	(株)ディスコ	DAD3220

;; 塑性加工 Plastic Working

装置名	メーカー名	型番
鍛造設備 (油圧プレス)	川崎油工(株)	HFP2-300
70ton大型スウェーjingマシン	(株)日本クロス圧延	15HP-DH4
18ton小型スウェーjingマシン	(株)日本クロス圧延	USD-6000
熱間2段ロール圧延機	大野ロール(株)	HOT-12
溝ロール圧延機	大野ロール(株)	2RMG-400S
冷間4段ロール圧延機	(株)日本クロス圧延	120DX270W-300DX250W
歪み速度制御圧延機	大野ロール(株)	2RM-400S
鍛圧用加熱炉 (max.1250℃)	日新化熱工業(株)	—
鍛圧用移動式加熱炉 (max.1200℃)	日新化熱工業(株)	EBS-1(S)
溝圧用加熱炉 (max1250℃)	光洋サーモシステム(株)	SB-20232
熱処理炉 (max1400℃)	日新化熱工業(株)	EBS-10(S)
焼鈍用熱処理炉 (max.850℃)	日新化熱工業(株)	EB-5S
1500t鍛造シミュレータ	住友重機械工業(株)、他3社	—
25t加工熱処理シミュレータ	富士電波工機(株)	Thermecmaster Z

;; 素材作製 Metal working

装置名	メーカー名	型番
水冷銅ルツボ高周波誘導溶解設備	富士電機(株)、NIMS	-
5kg高周波誘導真空溶解設備	日新技研(株)	NEV-M5V
30キログラム高周波誘導真空溶解設備	日新技研(株)	NEV-M30
加圧式エレクトロスラグ再溶解設備	日本特殊機械(株)	型番なし
金属箔圧延機	(有)トップラントエンジ	—
マルチ冷却式真空熱処理炉	佐藤真空(株)	—
電子ビーム溶接機	三菱電機(株)	EBW-35HB
ワイヤ放電加工機	ファナック(株)	α-C400iA
リサイクル分取GPC	日本分析工業(株)	LC-9201
グローブボックス	MBRAWN	Uni Lab
生体分子分離装置群(超遠心機)	ベックマン・コールター(株)	Optima-LE80K
材料調製装置群(スプレードライヤー)	Buchi	B-290

材料調製装置群(電気炉)	(株)アドバンテック	FUH632DA
材料調製装置群(プラズマクリーナー)	ヤマト科学(株)	PDC200
材料調製装置群(凍結乾燥機)	東京理化工機(株)	FDU-2110
機械工作室 工作機械群	—	—
試料作製室装置群	—	—
硝子工作室装置群	—	—
材料創製共通設備群	—	—

観察・評価 Observation/Evaluation

:: 電子顕微鏡 Electron microscope

微細組織三次元マルチスケール解析装置	(株)日立ハイテクサイエンス	SMF-1000
TEM試料作製用集束イオンビーム加工装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)	ThermoFisher Scios2
TEM試料自動作製FIB-SEM複合装置	(株)日立ハイテク	Ethos NX5000
FIB加工装置(JIB-4000)	日本電子(株)	JIB-4000
FIB加工装置(JEM-9310FIB)	日本電子(株)	JEM-9310FIB
FIB加工装置(JEM-9320FIB)	日本電子(株)	JEM-9320FIB
FIB/SEM精密微細加工装置	日本エフイー・アイ(株)	Helios 650
デュアルビーム加工観察装置(NB5000)	(株)日立ハイテクノロジーズ	NB5000
清浄表面組織観察FIB-SEM装置	カールツァイス(株)	ZEISS AurigaLaser
極低加速電圧電界放出形走査電子顕微鏡 (SU8000)	(株)日立ハイテクノロジーズ	SU8000
電界放出形走査電子顕微鏡 (S-5500)	(株)日立ハイテクノロジーズ	S-5500
電界放出形走査電子顕微鏡 (JSM-6500F)	日本電子(株)	JSM-6500F
走査電子顕微鏡 (JSM-6510)	日本電子(株)	JSM-6510
走査電子顕微鏡(JSM-7000F)	日本電子(株)	JSM-7000F
走査型電子顕微鏡	日本電子(株)	JEOL JSM-7900F
ショットキー電界放出型走査電子顕微鏡	日本電子(株)	JSM7001F
卓上電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ	Miniscope TM3000
卓上電子顕微鏡 [TM3000]	(株)日立ハイテクノロジーズ	TM3000
卓上電子顕微鏡(TM4000PlusII)	(株)日立ハイテク	TM4000PlusII
FE-SEM [S-4800]	(株)日立ハイテクノロジーズ	S-4800
FE-SEM+EDX [S-4800]	(株)日立ハイテク / (株)堀場製作所	S4800 / X-MAX 80
FE-SEM+EDX [SU8000]	(株)日立ハイテク / Bruker	SU8000 / Quantax FQ5060
FE-SEM+EDX [SU8230]	(株)日立ハイテクノロジーズ	SU8230
200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1)	日本電子(株)	JEM-2100F1
200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F2)	日本電子(株)	JEM-2100F2

200kV透過電子顕微鏡(JEM-2100)	日本電子(株)	JEM-2100
200kV透過電子顕微鏡(Talos F200X G2)	日本エフイー・アイ(株)	Talos F200X G2
局所変形観察・解析電子顕微鏡 (透過型電子顕微鏡)	日本電子(株)	JEOL JEM-2800
300kV収差補正電子顕微鏡 (Grand-ARM)	日本電子(株)	JEM-ARM300F
2軸傾斜バイアス印加・加熱TEM試料ホルダー	DENSsolutions	Lightning
2軸傾斜液体窒素冷却TEM試料ホルダー	Gatan, Inc.	Gatan 636
単原子分析電子顕微鏡(FEI Titan Cubed)	日本エフイー・アイ(株)	FEI Titan Cubed
実動環境対応物理分析電子顕微鏡(JEM-ARM200F-G)	日本電子(株)	JEM-ARM200F-G
実動環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡(JEM-ARM200F-B)	日本電子(株)	JEM-ARM200F-B
広空間・高分解能分析電子顕微鏡	日本電子(株)	JEOL JEM-ARM300F
ウルトラマイクロトーム(Leica EM UC6)	ライカマイクロシステムズ(株)	EM UC6
断面試料作製装置 (SM-09020CP)	日本電子(株)	SM-09020CP
ハイブリッドコーター(Q150RES)	クォーラムテクノロジーズ	Q150RES
オスミウムコーター	日本レーザー電子(株)	NL-OPC80A
オスミウムコーター	日本レーザー電子(株)	NL-OPC80A
カーボンコーター	日本電子(株)	JEC-560
金コーター	日本電子(株)	JFC-1500
白金コーター	日本電子(株)	JFC-1600
マルチコーター	(株)真空デバイス	VES-30T
HRTEM解析システム	—	—
DPC解析システム	(有)HREM	qDPC 64bit
電子線トモグラフィー解析システム	—	—
精密コーティングシステム	Gatan, Inc.	Model 682
精密イオン研磨装置(PIPS)	Gatan, Inc.	Model 691
精密イオン研磨装置(PIPS II)	Gatan, Inc.	Model 695
精密イオン研磨装置	Gatan, Inc.	695PIPS II
イオンスライサー	日本電子(株)	EM-09100IS
ターボ式真空蒸着装置	サンヨー電子(株)	SVC-700
卓上SEM	(株)日立ハイテック	TM4000PlusII
超音波ディスクカッター	Gatan, Inc.	Model 601
自動精密切断機 (ISOMET)	BEUHLER Ltd.	-
楔形研磨装置	Allied High Tech Products, Inc.	-
小型精密切断器	Technoorg Linda Co. Ltd.	MS2 MICROSAW
卓上研磨機	(株)マルトー	ML-180 DoctorLap
ディンプルグラインダー	Gatan, Inc.	656 DimpleGrinder
ディンプルグラインダー	Gatan, Inc.	656 DimpleGrinder
ピックアップシステム	—	ピックアップシステム

無損傷電子顕微鏡試料薄片化装置	フィッショナー	Model 1040 Nanomill
イオンスパッタ [E-1045]	(株)日立ハイテクノロジーズ	E-1045
TEM試料作製補助装置群	—	—
親水化処理装置	日本電子株式会社	DII-29020HD

;; プロブ顕微鏡 Probe microscope

装置名	メーカー名	型番
走査型プロブ顕微鏡 [Jupiter XR]	オックスフォード・インストゥルメンツ(株)	Jupiter XR
走査型プロブ顕微鏡 [L-trace]	SII ナノテクノロジー(株)	L-Trace
走査型プロブ顕微鏡 [Nanoscope5]	ブルカージャパン(株)	Nanoscope 5
走査プロブ顕微鏡	日本電子(株)	JSPM-5200
液中原子間力顕微鏡	ブルカージャパン(株)	NanoWizard 4 XP

;; 光学顕微鏡 ・ 評価 Optical Microscope/ Optical evaluation

装置名	メーカー名	型番
多角度光散乱検出器	ファイアット・テクノロジー	DAWN HELEOS
フーリエ変換赤外分光光度計	(株)島津製作所	IRTracer-100
フーリエ変換赤外分光光度計 (IRAffinity-1S)	(株)島津製作所	IRAffinity-1S/AIM-9000
円二色性分散計	日本分光(株)	J-725
プレートリーダー	(株)パーキンエルマージャパン	EnSight
ラマン顕微鏡	レニショー(株)	inVia Reflex
レーザーマイクロダイセクションシステム	ライカマイクロシステムズ(株)	LMD7000
レーザー顕微鏡 [LEXT OLS4000]	オリンパス(株)	LEXT OLS4000
レーザー顕微鏡 [VK-9700]	(株)キーエンス	VK9-9700G
共焦点顕微鏡SP5	ライカマイクロシステムズ(株)	SP5
デジタル顕微鏡	ハイロックス	RH-8800
分子材料分光分析装置群(分光光度計)	(株)日立ハイテクノロジーズ	U-2900
分子材料分光分析装置群(蛍光分光光度計)	(株)日立ハイテクノロジーズ	F-7000

;; 形状評価 Profile evaluation

装置名	メーカー名	型番
触針式プロファイラー [Dektak XT-A]	ブルカージャパン(株)	Dektak XT-A
触針式プロファイラー [Dektak 6M]	ブルカージャパン(株)	DekTak 6M
高精度三次元座標測定機	(株)ミットヨ	CRYSTA-Apex S9106

分析・計測 Analysis/Measurement

強磁場計測 High Magnetic Field Measurement

装置名	メーカー名	型番
NMR	日本電子(株)	ECS-400
500MHz固体汎用NMRシステム	日本電子(株)	ECA500
500MHz固体高分解能NMRシステム	日本電子(株)	ECA500
800MHzナローボア固体高分解能NMRシステム	日本電子(株)	ECA800
800MHzワイドボア固体高分解能NMRシステム	日本電子(株)	ECZ800
大口径超伝導マグネット	(株)東芝、NIMS	-
18T汎用超伝導マグネット装置	ジャパン スーパーコンダクタ テクノロジー(株)	JSD-18T52
試料振動型磁化測定装置(VSM)	オックスフォード・インストゥルメンツ(株)	Maglab VSM system
冷凍機伝導冷却型12T超伝導マグネット装置	ジャパン スーパーコンダクタ テクノロジー(株)	JMTD-12T100
大口径17Tマグネット	ジャパン スーパーコンダクタ テクノロジー(株)	F015
強磁場光学測定システム	クライオジェニック	-

X線回折 X-ray diffraction

装置名	メーカー名	型番
2波長CCD低温単結晶X線回折装置	(株)リガク	VariMax DW with Saturn
温度可変型粉末X線回折装置	(株)リガク	SmartLab (9 kW) with cryostat/furnace
高輝度・高感度型粉末X線回折装置	(株)リガク	SmartLab (9 kW)
高速・高感度型粉末X線回折装置	(株)リガク	SmartLab3
多環境場対応型X線単結晶構造解析装置	(株)リガク	XtaLAB SynergyCustom DW
簡易型粉末X線回折装置	(株)リガク	MiniFlex600
簡易型粉末回折計-Cr	(株)リガク	MiniFlex600-Cr
簡易型粉末回折計-Cu_N1	(株)リガク	MiniFlex600-Cu
卓上型粉末回折計-Cu_N2	(株)リガク	MiniFlex600-Cu_N2
XRD (粉末)	(株)リガク	RINT-Ultima III
XRD (薄膜)	(株)リガク	SmartLab

元素分析 Elemental analysis

装置名	メーカー名	型番
電界放出形電子線プローブマイクロアナライザー装置 (JXA-8500F)	日本電子(株)	JXA-8500F
誘導結合プラズマ発光分析装置(マルチ型) (720 ICP-OES)	アジレント・テクノロジー(株)	720 ICP-OES
誘導結合プラズマ発光分析装置(高分解能型) (SPS3520UV-DD)	(株)日立ハイテクサイエンス	SPS3520UV-DD
誘導結合プラズマ発光分光分析装置(マルチ型・デュアルビュー)	アジレント・テクノロジー(株)	Agilent5800

微小部蛍光X線分析装置 (ORBIS PC)	アメテック(株)	ORBIS PC
走査型オージェ電子分光分析装置 (JAMP-9500F)	日本電子(株)	JAMP-9500F
走査型硬X線光電子分光分析装置	アルバック・ファイ(株)	Quantes
X線光電子分光分析装置(Quantera SXM)	アルバック・ファイ(株)	Quantera SXM
酸素窒素水素分析装置(OXH836)、炭素硫黄分析装置(CS844)	LECOジャパン(同)	ONH836、CS844
イオンクロマトグラフシステム	サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)	ICS1600

:: 質量分析 Mass Spectrometry

装置名	メーカー名	型番
二重収束型ICP質量分析装置(ELEMENT XR)	サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)	ELEMENT XR
飛行時間型二次イオン質量分析装置(TOF-SIMS)	アルバック・ファイ(株)	PHI TRIFT V nanoTOF
マルチガス導入グロー放電質量分析システム(VG9000)	サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)	VG9000
四重極型ICP質量分析装置	アジレント・テクノロジー(株)	Agilent7850
LC/MS/MS	AMR, Inc.	Zaplous
LC/MS/MS (Q-exactive)	サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)	Q-Exactive Plus

:: 電気計測 Electric measurement

装置名	メーカー名	型番
室温ブローバー [MX-200/B]	ベクターセミコン(株), アジレント・テクノロジー(株)	MX-200/B, B1500A
室温ブローバー [HMP-400]	アジレント・テクノロジー(株), ハイソル(株)	B1500A
低温ブローバー [GRAIL-408-32-B]	Keithley Instruments, Inc., ナガセテクノエンジニアリング(株)	4200 SCS, Grail-408-32-B
液体窒素ブローバー [SB-LN2]	サーマルブロック ケースレーインズツルメンツ	SB-LN2PS, 4200-SCS
ワイヤーボンダー [7476D #1]	West-Bond	Model 7476D
ワイヤーボンダー [7476D #2]	ハイソル(株)(West-Bond)	7476D

:: 物性評価 Physical properties evaluation

装置名	メーカー名	型番
エリブソメーター [MARY-102FM]	ファイブラボ(株)	MARY-102FM
分光エリブソメーター [M2000]	J.A. Woollam Co.	M-2000U
顕微分光膜厚計 [F54-XY-200-UV]	フィルメトリクス(株)	F54-XY-200-UV
薄膜応力測定装置 [FLX-2000-A]	東朋テクノロジー(株)	FLA-2000-A
熱分析装置(TG/DTA+DSC)	(株)日立ハイテクサイエンス	TG/DTA 6200, X-DSC7000
ゼータ電位&粒径測定装置	大塚電子(株)	ELSZ-2000ZS
紫外可視近赤外分光計V-770	日本分光(株)	V-770
蛍光分光計	日本分光(株)	FP-8500DS
蛍光分光計 (Fluorolog-3)	(株)堀場製作所	Fluorolog-3

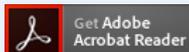
高感度・走査型示差熱量計	ネッチ(株)	DSC200F
高分子相構造解析システム	大塚電子(株)	PP-1000
フーリエ変換赤外分光計	日本分光(株)	FT/IR-6700
分子材料分離分析装置群(GPC-1)	(株)島津製作所	Nexera 40
分子材料分離分析装置群(GPC-2)	昭和電工(株)	Shodex GPC-101
材料分析装置群(接触角測定装置)	AST products, Inc.	VCA Optima XE
材料分析装置群(強度物性測定器)	英弘精機(株)	TA-XT2i
ナノ材料分析装置群(パーティクルサイズアナライザー)	(株)島津製作所	SALD-2100
ナノ材料分析装置群(動的光散乱計)	大塚電子(株)	DLS-8000HAL
ナノ材料分析装置群(レーザーゼータ電位計)	大塚電子(株)	ELSZ-1000Z

;; バイオ Biological analysis

装置名	メーカー名	型番
リアルタイムPCR	ロシュ・ダイアグノスティクス(株)	LightCycler 480 System II
マイクロアレイスキャナー	アジレント・テクノロジー(株)	SureScan G4900DA
細胞分離分析システム	ソニー(株)	Cell sorter SH800 / Cell analyzer SP6800
CO2インキュベーター	三洋電機(株)	MCO-40AIC
クリーンベンチ	ヤマト科学(株)	ADS131RMUGZ
表面プラズモン解析装置	GEヘルスケア・ジャパン(株)	Biacore-X100
安全キャビネット	三洋電機(株)	MH131AJ

↓ 関連ダウンロード

 [共用設備一覧](#) PDF形式 / 770.66KB



PDFファイルをご覧いただくには[Adobe Acrobat Reader](#)が必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックして[Adobe Acrobat Reader](#)をダウンロード(無料)してください。

☎ お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは技術開発・共用部門です。

[メールでのお問い合わせはこちら](#)